

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 576 944 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **93109837.0**

(51) Int. Cl.⁵: **B01J 37/02, B01J 37/34**

(22) Anmeldetag: **21.06.93**

(30) Priorität: **26.06.92 DE 4221011**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.01.94 Patentblatt 94/01

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: **Guenter, Lauth, Dr.**
Kaendelgasse 46
D-6711 Grosskarlbach(DE)
Erfinder: **Hoelderich, Wolfgang, Prof. Dr.**
Mannheimer Strasse 18c
D-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Harth, Klaus, Dr.**
Starenweg 6
D-6719 Altleiningen(DE)
Erfinder: **Hibst, Hartmut, Dr.**
Branichstrasse 23
D-6905 Schriesheim(DE)

(54) **Schalenkatalysatoren.**

(57) Schalenkatalysator, hergestellt durch Abscheidung einer Legierung durch physical vapor deposition und/oder durch chemical vapor deposition auf einem Formkörper, wobei mindestens eine Legierungskomponente ein Metall aus der Gruppe von Aluminium, Gallium, Silizium, Germanium, Zinn, Blei, Wismut, Yttrium, Titan, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Eisen, Cobalt, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer, Silber, Gold und Zink ist.

EP 0 576 944 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Schalenkatalysatoren, hergestellt durch Abscheidung einer Legierung durch physical vapor deposition und/oder durch chemical vapor deposition auf einem Formkörper.

Es ist bekannt, daß für einige katalytische Umsetzungen, insbesondere Selektivhydrierungen z.B. von Cyclooctadien und Oxidationsreaktionen mit Sauerstoff in Gasphase z.B. Acrolein und Acrylsäure aus Propen oder Phthalsäureanhydrid aus Xylol, Katalysatoren mit Schalenstruktur besonders geeignet sind. Dabei kann die Schalendicke Aktivität und Selektivität wesentlich beeinflussen (T. Haas, Chr. Otto und J. Gaube, Dechema-Monographien, Band 113, Seite 205 bis 220 (1988)).

Eine gezielte Herstellung von Schalenkatalysatoren mit definierter Dicke ist, insbesondere mit Hilfe der gebräuchlichen Träbertechnik, kaum oder unter extrem hohem Arbeitsaufwand möglich.

Die katalytische Aktivität von Legierungen, insbesondere nach einer Vorbehandlung (Aktivierung), ist z.B. aus J. Phys. Chem., 83 (1979), S. 2009 bis 2012 bekannt. Bei bestimmten katalytischen Umsetzungen haben sich vor allem amorphe Legierungen als günstige Ausgangsmaterialien erwiesen. Diese werden entweder direkt, oder nach einer Vorbehandlung als Katalysatoren eingesetzt. (M. Shibata und T. Masumoto: "Amorphous Alloys as Catalysts or Catalyst Precursors" in "Preparation of Catalysts IV", Studies in Surface Science and Catalysis, DB. Delmon, P. Grange, P.A. Jacobs, G. Poncelet (Hrsg.), Seite 353 bis 371, 1987 Elsevier, Amsterdam). Hierbei handelt es sich um sogenannte Vollkatalysatoren.

Die Herstellung eines Katalysators aus einer Legierung, insbesondere einer amorphen Legierung, ist indes schwierig. Das Zerkleinern der üblicherweise kompakten Legierung bereitet ebenso Schwierigkeiten wie die Verformung der zerkleinerten Legierung zu einem in der Katalyse gebräuchlichen Formkörper. Ebenso ist die Herstellmethode z.B. über das Schmelzspinnverfahren recht diffizil. Auch handelt es sich hierbei immer um die Herstellung von Vollkatalysatoren.

Die Herstellung von Schalenkatalysatoren mit definierter Schalendicke aus herkömmlich hergestellten Legierungen ist nicht möglich.

Es ist bekannt, daß amorphe Legierungsschichten auch durch physikalische oder chemische Abscheidung unter Niederdruckbedingungen hergestellt werden können, in der Fachsprache als physical vapor deposition (PVD-Abscheidung) oder chemical vapor deposition (CVD-Abscheidung) bezeichnet (vgl. R.F. Bhunshah et al, "Deposition Technologies for Films and Coatings", Noyes Publications, 1982). Bekannte PVD-Verfahren sind das Aufdampfen, die Kathodenzerstäubung ("Sputtern") oder die Lichtbogenabscheidung, bekannte CVD-Verfahren umfassen die thermische CVD-Beschichtung sowie die plasmaunterstützte CVD-Beschichtung.

Es sind bereits mehrere Anwendungen von amorphen PVD/CVD-Schichten bekannt, wobei jedoch flache, in der Regel großflächige Träger mit glatten Oberflächen eingesetzt werden. So wird beispielsweise in löschbaren magnetooptischen Speicherplatten eine durch Kathodenzerstäubung hergestellte amorphe Legierungsschicht aus Seltenen Erden und Übergangsmetallen zur Informationsspeicherung verwendet (DE-A-23 42 886).

Eine weitere Anwendung betrifft die Herstellung von Dünnschichtmetall-Widerständen durch die Abscheidung feinkristalliner (Ni-Cr)-Schichten auf geeignete Keramikträger mittels Kathodenzerstäubung.

Aus Nippon Kagaku Kaishi, Seite 1064 bis 1069 (1985) ist die Herstellung von amorphen Nickel-Bor-Schichten durch plasmaunterstützte Abscheidung eines B_2H_6 , Ar, H_2 -Gemisches in Nickelreaktoren und deren katalytische Aktivität bei der Hydrierung von 1,3-Butadien bekannt.

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde Schalenkatalysatoren auf einfacherem Wege herzustellen.

Demgemäß wurden neue Schalenkatalysatoren, hergestellt durch Abscheidung einer Legierung durch physical vapor deposition und/oder durch chemical vapor deposition auf einem Formkörper, gefunden, wobei mindestens eine Legierungskomponente ein Metall aus der Gruppe von Aluminium, Gallium, Silizium, Germanium, Zinn, Blei, Wismut, Yttrium, Titan, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Eisen, Cobalt, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer, Silber, Gold und Zink ist.

Das Aufbringen der Deckschicht auf den Grundkörper erfolgt durch physikalische oder chemische Abscheidung unter Vakuum, in der Fachsprache als physical vapor deposition (PVD) oder chemical vapor deposition (CVD) bezeichnet. Unter Vakuum ist dabei ein Druck von weniger als 10 mbar, insbesondere von weniger als 1 mbar zu verstehen. Mögliche PVD-Verfahren sind das Aufdampfen, die Kathodenzerstäubung sowie die anodische oder kathodische Lichtbogenbeschichtung. Mögliche CVD-Verfahren sind die thermische oder plasmaunterstützte Gasphasenabscheidung. Bevorzugt sind plasmaunterstützte Verfahren, wie Kathodenzerstäubung oder Arc-Beschichtung, wobei die Kathodenzerstäubung besonders bevorzugt ist.

Bei der Lichtbogenbeschichtung erfolgt der Abtrag des Beschichtungsmaterials mit einem elektrischen Lichtbogen ("Arc"), der zu einem hohen Ionisationsgrad des Beschichtungsmaterials in der Prozeßgasatmosphäre führt. Der zu beschichtende Formkörper kann mit einer in der Regel negativen Vorspannung

versehen werden, welche zu einem intensiven Ionenbeschuß während der Beschichtung führt.

Bei der Kathodenzerstäubung werden die zu beschichtenden Materialien in fester Form als sog. Target auf die Kathode des Plasmasystems aufgebracht, im Vakuum (vorzugsweise 5×10^{-4} bis 1×10^{-1} mbar) in einer Prozeßgasatmosphäre zerstäubt und auf dem Formkörper abgeschieden. Üblicherweise enthält das

Prozeßgas ein Edelgas wie Argon.
Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Schichten sind verschiedene methodische Varianten der Kathodenzerstäubung, wie Magnetron-Sputtern, DC- bzw. RF-Sputtern, Bias-Sputtern oder reaktives Sputtern sowie deren Kombinationen geeignet. Beim Magnetron-Sputtern befindet sich das zu zerstäubende Target in einem äußeren Magnetfeld, welche das Plasma in den Bereich des Targets konzentriert und damit eine Erhöhung der Zerstäubungsrate bewirkt. Beim DC- bzw. RF-Sputtern erfolgt die Anregung des Zerstäubungsplasmas in an sich bekannter Weise durch DC-bzw. RF-Generatoren. Beim Bias-Sputtern wird der zu beschichtende Formkörper mit einer in der Regel negativen Vorspannung (Bias) belegt, welche während der Beschichtung zu einem intensiven Beschuß des Formkörpers mit Ionen führt.

Bei der reaktiven Kathodenzerstäubung ("reaktives Sputtern") werden dem Prozeßgas weitere reaktive Gase wie Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe, Sauerstoff, Stickstoff u.a. in der gewünschten Menge zu einem geeigneten Zeitpunkt zugemischt. Hierdurch kann man durch Zerstäubung eines Metalls beispielsweise in der Gegenwart von Kohlenwasserstoffen, Sauerstoff und/oder Stickstoff im Prozeßgas direkt die betreffenden Metalloxid-, -nitrid-, -carbid-, -carbidoxid-, -carbidenitrid-, -oxidnitrid- oder -carbidoxidnitrid-Schichten abscheiden.

Die Einstellung der gewünschten Schichtdicke, chem. Zusammensetzung und Mikrostruktur erfolgt dabei wie nachfolgend beschrieben durch die Beschichtungsparameter Prozeßgasdruck, Prozeßgaszusammensetzung, Zerstäubungsleistung, Sputtermodus, Substrattemperatur und Beschichtungszeit.

PVD/CVD-Verfahren ermöglichen eine sehr reproduzierbare und durch die Beschichtungsparameter (z.B. Beschichtungsrate, Beschichtungszeit) in einfacher Weise veränderbare Einstellung der Schichtdicke. Sie kann dabei bequem zwischen wenigen Atomlagen und ca. 100 µm gewählt werden. Für Schalenkatalysatoren sind Schichtdicken im Bereich von 100 nm bis 50 µm bevorzugt, insbesondere aber 300 nm bis 20 µm und ganz besonders zwischen 0,5 µm und 10 µm.

PVD-/CVD-Technologien, insbesondere die Sputtertechnologie, bieten sehr große Freiheiten hinsichtlich der chem. Zusammensetzung der Legierungsschicht. Das Spektrum der herstellbaren Schichten reicht von zwei- über drei- oder mehrkomponentige metallische Legierungen bis hin zu oxidischen, nitridischen oder carbidischen Mischsystemen.

Die Herstellung mehrkomponentiger metallischer Legierungen erfolgt dabei üblicherweise durch Einbringen eines geeigneten Targets in die Beschichtungsanlage und durch anschließendes Zerstäuben des Targets in einem Edelgasplasma, bevorzugt in Argon. Geeignete Targets sind entweder homogene Legierungstargets, die in bekannter Weise durch Schmelzverfahren bzw. durch pulvermetallurgische Methoden hergestellt werden, oder inhomogene Mosaiktargets, die durch Zusammenfügen kleinerer Teilstücke unterschiedlicher chem. Zusammensetzung oder durch Auflegen bzw. Aufkleben von kleinen scheibenförmigen Materialstücken auf homogene Targets hergestellt werden. In alternativer Weise können metallische Legierungen dadurch hergestellt werden, daß zwei oder mehrere Targets unterschiedlicher Zusammensetzung gleichzeitig zerstäubt werden (simultanes Sputtern). Die zu beschichtenden Formkörper werden dabei so angeordnet, daß sie dem durch die Zerstäubung bewirkten Materialfluß von den verschiedenen Targets in günstiger Weise ausgesetzt werden. In einer vorteilhaften Anordnung werden die zu beschichtenden Formkörper dabei in periodischer Weise durch die simultan brennenden Zerstäubungsplasmen geführt, wobei auf die Formkörper eine Schicht aufgebracht wird, deren Zusammensetzung in der Schichttiefe periodisch moduliert. Die Modulationsperiode kann dabei durch die Sputterleistung der Einzeltargets sowie durch die Geschwindigkeit der periodischen Bewegung der Formkörper in weiten Grenzen eingestellt werden. Insbesondere ist es dabei auch möglich, durch die Einstellung einer sehr kleinen Modulationsperiode eine sehr innige Vermischung der Einzelschichten und damit die Abscheidung einer homogenen Legierung zu ermöglichen.

Die Herstellung oxidischer, nitridischer oder carbidischer Mischsysteme kann entweder durch die Zerstäubung entsprechender Oxid-, Nitrid- oder Carbid-Targets oder durch die reaktive Zerstäubung von Metalltargets in entsprechenden Reaktivgasplasmen erfolgen. Durch eine entsprechende Steuerung des Reaktivgasflusses während des reaktiven Sputterns ist es dabei auch möglich, eine partielle Oxidation, Nitrierung oder Carbrierung der Legierungsschicht zu erreichen. So kann beispielsweise bei Legierungen aus edlen und unedlen Metallen durch eine geschickte Einstellung des O_2 -Gasflusses eine selektive Oxidation der unedlen Metallkomponente erreicht werden.

Mit den genannten Abscheideverfahren ist es auch möglich, dünne Gradientenschichten herzustellen, deren Zusammensetzung mit zunehmender Schichttiefe in definierter Weise variiert wird. Die Variation der

Zusammensetzung kann dabei in einfacher Weise durch die entsprechenden Beschichtungsparameter (z.B. Sputterleistung beim simultanen Sputtern, Reaktivgasfluß etc.) gesteuert werden. Darüber hinaus sind auch nicht-periodische Schichtsysteme, beispielsweise Schichtsysteme aus unterschiedlichen metallischen Legierungen oder Schichtverbunde aus metallischen und oxidischen Schichten denkbar.

Die Mikrostruktur (z.B. Phasenverteilung, Kristallitform und -größe, kristallographische Ausrichtung) sowie die Porosität der Schichten kann durch die Wahl geeigneter Abscheideparameter in weiten Grenzen gesteuert werden. So führt beispielsweise die DC-Magnetron-Kathodenzerstäubung eines metallischen Targets im Druckbereich von 4×10^{-3} bis 8×10^{-3} mbar zu sehr dichten und damit porenfreien Schichten, während bei einem Sputterdruck oberhalb 1×10^{-2} mbar eine säulenförmige Morphologie mit einer zunehmenden Porosität beobachtet wird. Neben dem Sputterdruck besitzt die Substrattemperatur sowie ein eventuell angelegter Bias einen hohen Einfluß auf die Mikrostruktur.

Während mit den üblichen Methoden zur Herstellung amorpher Legierungen, die nach dem Prinzip des schnellen Abschreckens einer Schmelze arbeiten, nur Legierungszusammensetzungen in der Nähe des Eutektikums oder der Eutektika herzustellen sind, ermöglichen die erfindungsgemäßen Verfahren die Herstellung amorpher oder nanokristalliner Legierungen über einen wesentlich breiteren Kompositionsbereich. Die Abkühlrate beim Auftreffen eines durch Kathodenzerstäubung erzeugten Species (Atom, Molekül, Cluster) auf das zu beschichtende Substrat übertrifft um ein Vielfaches die Abkühlraten beim Abschrecken einer makroskopischen Schmelze. Der (thermodynamisch nicht stabile) amorphe Zustand einer Legierung kann daher bei den erfindungsgemäßen Verfahren wesentlich leichter "eingefroren" werden als bei den konventionellen Verfahren. Darüber hinaus begünstigen die bereits oben beschriebenen Möglichkeiten der Herstellung von periodischen Vielfachschichten mit modifizierter atomarer Nahordnung wesentlich die Ausbildung einer amorphen Struktur. Mit der Erfindung sind somit amorphe Legierungen zugänglich, die auf andere Weise nicht erhältlich sind.

Als Träger kommen z.B. Formkörper aus Glas, Quarzglas, Keramik, Titandioxid, Zirkondioxid, Aluminiumoxid, Aluminosilikate, Borate, Steatit, Magnesiumsilikat, Siliciumdioxid, Silicaten, Metall, Kohlenstoff z.B. Graphit oder Mischungen der genannten Materialien in Frage. Der Träger kann porös oder nicht porös sein. Als Formkörper kommen in Betracht z.B. Stränge, Tabletten, Wagenräder, Sterne, Monolithe, Kugeln, Splitt, Ringe, Extrudate. Besonders bevorzugt sind Kugeln, Tabletten und Stränge.

Um eine gleichmäßige Beschichtung der Träger zu erzielen, ist es vorteilhaft, die Träger während der Beschichtung mit geeigneten mechanischen oder strömungsmechanischen Vorrichtungen in statistischer Bewegung zu halten. Geeignete mechanische Vorrichtungen sind beispielsweise periodisch bewegte Käfige, Trommeln, Schalen oder Rinnen, in denen die Träger zu statistischen Bewegungen angeregt werden. Die mechanische Vorrichtung muß dabei natürlich geeignete Öffnungen zum Durchlaß des Beschichtungsmaterials oder zum Durchgriff eventuell benötigter Plasmen besitzen.

Die Haftung der Legierung auf dem Träger ist in der Regel sehr hoch. Sie kann bei Bedarf durch eine vor der eigentlichen Beschichtung durchzuführende Plasmaätzbehandlung des Trägers weiter gesteigert werden.

Die beschichteten Formkörper können durch eine geeignete Behandlung in ihrer katalytischen Aktivität stark erhöht werden. Diese Behandlung besteht z.B. in einer thermischen Behandlung oder in der selektiven Reaktion eines der Legierungskomponenten mit einem Gas oder Gasgemisch bei höherer Temperatur. Insbesondere die selektive Oxidation der unedleren Komponente der Legierung zu einem Oxid dieser Komponente oder die Nitrierung einer Komponente zum Nitrid dieser Komponente sei erwähnt. Die restliche Komponente oder Komponenten der Legierung liegen danach im allgemeinen in metallischer Form fein verteilt in der Oxid- bzw. Nitrid-Matrix vor. Die Kontaktfläche zwischen Nitrid bzw. Oxid und diesen metallischen Komponenten ist in der Regel sehr groß, was die katal. Aktivität und/oder Selektivität positiv beeinflussen kann. Die Sinterstabilität der metallischen Komponenten ist in der Regel sehr hoch.

Die Nachbehandlung der beschichteten Formkörper kann auch durch Behandlung mit Säuren wie HF, HCl, HNO₃, H₃PO₄, Basen wie NaOH, CrOH, Ba(OH)₂, Sr(OH)₂, KOH, RbOH oder sonstigen Reagenzien wie Sulfonsäuren oder halogenierten Kohlenwasserstoffen erfolgen, welche eine oder mehrere Komponenten der Legierung herauslösen oder mit einer oder mehreren Komponenten der Legierung reagieren oder oberflächlich behandeln.

Die spezifische Oberfläche der beschichteten Formkörper nimmt in der Regel bei der Nachbehandlung oder bei der katalytischen Reaktion zu. Die spezifische Oberfläche kann z.B. nach der gängigen weitläufig bekannten BET-Methode (Methode nach Brunauer, Emmet und Teller) bestimmt werden.

Geeignete Behandlungsverfahren sind z.B. das zur Reaktion bringen der beschichteten Formkörper mit oxidierend und/oder reduzierend wirkenden Gasen oder Gasgemischen wie z.B. Luft, Wasserstoff, Mischungen aus CO und Luft, CO₂ und H₂, N₂ und Wasserdampf, Luft und Wasserdampf bei Temperaturen von 100 bis 500 °C. Die Reaktionsdauer kann von einigen Minuten bis zu einigen Wochen betragen. Insbeson-

dere die Behandlung mit Mischungen aus CO/O₂, H₂/CO₂, CO/H₂/H₂O/N₂ führen zu einem Material mit hoher katalytischer Aktivität und einer deutlichen Erhöhung der BET-Oberfläche.

Nach der Erfindung enthält die auf die Formkörper aufgebrachte Legierungsschicht mindestens ein Metall aus der Gruppe von Aluminium, Gallium, Silizium, Germanium, Zinn, Blei, Wismut, Yttrium, Titan, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Eisen, Cobalt, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer, Silber, Gold und Zink. Insbesondere Legierungen mit sehr leicht oxidierbaren Komponenten wie z.B. Silizium, Aluminium, Zirkon oder Titan eignen sich zum Beschichten. Im allgemeinen enthalten die Legierungen weiterhin mindestens ein Element aus der Gruppe VIII oder IB des Periodensystems der Elemente. Besonders geeignete Legierungssysteme sind z.B. Pd-Zr, Ru-Zr, Pt-Zr, Cu-Zr, Fe-Zr, Ni-Zr, Ru-Re-Zr, Cu-Ti, Pd-Ti, Pt-Ti, Cu-Si, Pd-Si, Ru-Si, Pt-Pd-Si, Cu-Pt-Ti, Cu-Pt-Zr, Cu-Al, Pd-Al, Pt-Al, Ru-Sn-Si, Ru-Sn-Ti, Ru-Pb-Ti, Ru-Pb-Si, Au-Zr.

Die Zusammensetzung der Legierungen ist in großen Bereichen variierbar, so kann die unedelste Komponente in der Regel von 5 bis 95 Atomprozent enthalten sein. Die aufgesputterten Legierungen sind in der Regel amorph.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörper lassen sich verwenden für nukleophile und elektrophile Substitutionen, für Additions- und Eliminierungsreaktionen für Doppelbindungs- und Skelettisomerisierungen einschließlich Umlagerungen und für Redoxreaktionen z.B. für Alkylierungen, Isomerisierungen, Disproportionierungen, Acylierungen, Cyclisierungen, Hydratisierungen, Dehydratisierungen, Aminierungen, Hydrierungen, Dehydrierungen, Dehydrocyclisierungen, Hydroxylierungen, Oxidationen, Epoxidierungen, Skelettisomerisierungen sowie Kombinationen dieser Reaktionen, zur gezielten Umsetzung organischer Moleküle. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Formkörper können bei Umsetzungen, wie sie beispielsweise in W. Hölderich, "Zeolites: Catalysis for the synthesis of organic compounds", Stud. Surf. Sci. Catal., 49, (1989), S. 69 bis 93, oder W. Hölderich und H. van Bekkum "Zeolites in organic Syntheses", Stud. Surf. Sci. Catal. 58 (1991) 631-727, eingesetzt werden.

Die beschichteten Formkörper lassen sich - insbesondere nach einer Aktivierung - als Schalenkatalysatoren für Hydrierungs-, Oxidations- und Isomerisierungsreaktionen, ganz besonders für Selektivhydrierungsreaktionen einsetzen.

Beispiele hierfür sind:

Selektivhydrierung von Propin, Selektivhydrierung von Butadien, Selektivhydrierung von Acetylen, Selektivhydrierung von Butinol, Selektivhydrierung von Octadien zu Octen Selektivhydrierung von Benzol zu Cyclohexen Hydrierung von Kohlenmonoxid, Hydrierung von Kohlendioxid, Hydrierung von Maleinsäureanhydrid. Hydrierung von NO_x zu NH₃ oder NH₂OH Carbonsäureamid aus Nitrilen, Amine aus Carbonsäuren Aminierung von Aromaten, insbesondere Reaktion von Benzol mit Ammoniak zu Anilin. Reduktive Aminierung von Aldehyden und Ketonen zu Aminen. Wacker-Synthese, Acetaldehyd auf Basis Ethylen. Oxidation von Butan zu Maleinsäureanhydrid. Oxidation von Kohlenmonoxid. Oxidationen von Alkoholen zu Aldehyden, Ketonen oder Carbonsäuren. Oxidationen von Alkanen zu Alkoholen, Aldehyden und Ketonen. Oxidationen von Aldehyden/Ketonen zu Carbonsäuren. Hydroxylierung von Aromaten, z.B. Oxidation von Benzol zu Phenol oder Toluol zu Kresol. Oxidationen von Propylen zu Acrolein bzw. Acrylsäure. Ammonoxidationen z.B. von Toluol mit NH₃/O₂ zu Benzonitril oder Propylen zu Acrylnitril. Epoxide lassen sich in Aldehyde/Ketone und unter hydrierenden Bedingungen in Alkohole umwandeln, z.B. Styroloxid-Derivate zu den entsprechenden Phenylacetaldehyden bzw. unter hydrierenden Bedingungen zu Phenylethanol.

Beispiele

Beispiel 1

Herstellung des Katalysators I (Vergleichsbeispiel)

Eine amorphe Pd₃₃Zr₆₆-Legierung wird nach dem Schmelzspinn-Verfahren hergestellt. Das Material, welches in Form eines ca. 50 µm dicken Bandes vorliegt, ist röntgenamorph und besitzt keine meßbare BET-Oberfläche. Das Band wird mechanisch zerkleinert und 20 Stunden lang bei 320 °C mit Wasserdampf (Partialdruck ca. 40 mbar) behandelt. Das Röntgendiffraktogramm des Materials zeigt jetzt Linien von Palladium und Zirkondioxid; seine BET-Oberfläche beträgt ca. 15 m²/g. Das Material wird zu Pulver zermahlen und mit Aluminiumoxidhydroxid so gemischt, daß in der Mischung ein Palladiumgehalt von 0,25 % vorliegt. Diese Mischung wird zu Tabletten verformt und kalziniert. Für die katalytischen Reaktionen werden die Tabletten zu Splitt der Größe 1 - 1,6 mm zermahlen.

Beispiel 2

Herstellung des Katalysators II

5 Auf Glaskugeln mit 2 mm Durchmesser wird durch simultanes Sputtern eines Pd und eines Zr-Targets eine 1 µm dicke Pd₃₃Zr₆₆-Schicht aufgesputtert. Der Druck des Argongases beim Sputtern betrug 5·10⁻³ mbar; das Material ist röntgenamorph und besitzt keine meßbare BET-Oberfläche.

Die beschichteten Kugeln werden 20 Stunden lang bei 320 °C mit Wasserdampf (Partialdruck ca. 40 mbar) behandelt. Das Röntgendiffraktogramm des Materials zeigt jetzt Linien von Palladium und Zirkondio-
 10 xid; seine BET-Oberfläche beträgt ca. 0,3 m²/g. Das Material besitzt einen Palladiumgehalt von 0,25 %. Das Material kann direkt in einer katalytischen Reaktion eingesetzt werden.

Beispiel 3

15 Katalytische Hydrierung von 2-Butin-3-ol in der Gasphase

2-Butin-3-ol wird zusammen mit einer stöchiometrischen Menge Wasserstoff bei 150 °C über 5 g Katalysator geleitet. Die Belastung beträgt 2 g Butinol je g Katalysator und Stunde. Der Produktstrom wird kondensiert, in einer Vorlage gesammelt und mittels eines Gaschromatographen analysiert. Der Umsatz und
 20 die Selektivität bezüglich 2-Buten-3-ol werden nach folgenden Formeln berechnet:

$$\text{Umsatz} = \frac{[\text{2-Butin-3-ol}]_{\text{Edukt}} - [\text{2-Butin-3-ol}]_{\text{Produkt}}}{[\text{2-Butin-3-ol}]_{\text{Edukt}}} \times 100 \%$$

[...] = Molprozent der Verbindung im Edukt- bzw. Produktstrom

$$\text{Selektivität 2-Buten-3-ol} = \frac{[\text{2-Butin-3-ol}]_{\text{Produkt}}}{\text{Umsatz}} \times 100 \%$$

35 In der nachfolgenden Tabelle sind alle katalytischen Ergebnisse zusammengefaßt. Die verwendeten Katalysatoren sind bezüglich des Palladium-Gehaltes gleich:

Katalysator	Umsatz	Selektivität 2-Buten-3-ol
I (Vergleich)	50 %	78 %
II	97 %	84 %

45 Katalysator I ist ein Katalysator, hergestellt aus einer schmelzgesponnenen amorphen Legierung.

Katalysator II ist ein aktivierter Schalenkatalysator, hergestellt aus einem besputterten Formkörper.

Aus der Tabelle ist deutlich die Überlegenheit des neuartigen Schalenkatalysators, sowohl bezüglich des Umsatzes als auch bezüglich der 2-Buten-3-ol-Selektivität, zu erkennen.

50 Beispiel 4

Herstellung von Katalysator III

Auf Glaskugeln mit 2 mm Durchmesser wird durch simultanes Sputtern eines Cu und eines Zr-Targets
 55 eine 1 µm dicke Cu₇₀Zr₃₀-Schicht aufgesputtert. Der Druck des Argongases beim Sputtern betrug 5·10⁻³ mbar; das Material ist röntgenamorph und besitzt keine meßbare BET-Oberfläche.

Die Kugeln werden 20 Stunden lang bei 280 °C mit einer Mischung aus Wasserstoff und Kohlendioxid (molares Verhältnis 3:1, Gesamtdruck 1 bar) behandelt. Das Röntgendiffraktogramm des Materials zeigt

Linien von Kupfer und Zirkondioxid; seine BET-Oberfläche beträgt ca. $0,3 \text{ m}^2/\text{g}$. Das Material besitzt einen Kupfergehalt von 0,5 %.

Das Material kann direkt in einer katalytischen Reaktion eingesetzt werden.

5 Beispiel 5

Herstellung weiterer Katalysatoren durch Kathodenzerstäubung

10 Verschiedene Träger aus geeignetem Material und geeigneter Form (vgl. nachstehende Tabelle) wurden auf ein rundes Stahlnetz (Durchmesser 150 mm) mit einer Maschenweite von 0,4 mm aufgelegt und in eine Kathodenzerstäubungsanlage eingebracht. In einem Abstand von 60 mm wurden ein oder mehrere Targets entsprechend der Tabelle eingesetzt. Die Anlage wurde mit einem zweistufigen Pumpsystem auf einen Druck von 10^{-6} mbar evakuiert. Danach wurde Argon bis zu einem Druck von 9×10^{-3} mbar eingelassen. Durch Anlegen einer RF-Spannung an das Stahlnetz mit einer Leistung von 500 W wurden die
15 Träger für die Dauer von 1 min einer Sputterätzbehandlung unterzogen. Nach Abschluß der Ätzbehandlung wurde der Ar-Druck auf einen Wert entsprechend der Tabelle eingelassen. Durch Anlegen einer geeigneten Spannung an das oder die Targets wurde auf die Träger eine Schicht abgeschieden. Beim simultanen Sputtern mehrerer Targets wurde das Stahlnetz mit den Trägern periodisch über die verschiedenen Targets geführt. In allen Fällen wurden die Träger durch eine mechanische Anregung des Stahlnetzes statistisch
20 bewegt, um eine homogene Beschichtung zu gewährleisten. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle

Nr.	Träger	Target 1	Leistung 1 [W]	Target 2	Leistung 2 [W]	Sputterdruck [mbar]	Substrat- Modus	Zusammens. [At.-%]	Schichtdicke [nm]
1	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	1000
2	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	2,5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	1000
3	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	1000
4	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	5000
5	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	10000
6	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd ₁ Zr ₂ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	2,5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Pd ₃₄ Zr ₆₆	1000
7	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Cu ₇₀ Zr ₃₀ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	2,5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Cu ₇₀ Zr ₃₀	1000
8	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Cu ₇₀ Zr ₃₀ (150 mm Ø)	500 (RF)	-	-	2,5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Cu ₇₀ Zr ₃₀	5000
9	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd	10
10	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd	100
11	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻³ (Ar)	festat.	Pd	1000
12	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Pd	10
13	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5 x 10 ⁻² (Ar)	festat.	Pd	100

Nr.	Träger	Target 1	Leistung 1 [W]	Target 2	Leistung 2 [W]	Sputterdruck [mbar]	Substrat- Modus	Zusammens. [At.-%]	Schichtdicke [nm]
14	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5×10^{-2} (Ar)	festst.	Pd	1000
15	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5×10^{-3} (Ar)	festst.	Pd	100
16	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	25 (RF)	-	-	5×10^{-2} (Ar)	festst.	Pd	100
17	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	100
18	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
19	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	$2,5 \times 10^{-2}$ (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	100
20	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	$2,5 \times 10^{-2}$ (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
21	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 20 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	100
22	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 20 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
23	Beadgel (1,5 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 20 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	100
24	Beadgel (1,5 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
25	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	100
26	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
27	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	3×10^{-2} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000
28	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	100 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 20 U/min	Pd ₃₆ Zr ₆₄	1000

Nr.	Träger	Target 1	Leistung 1 [W]	Target 2	Leistung 2 [W]	Sputterdruck [mbar]	Substrat- Modus	Zusammens. [At.-%]	Schichtdicke [nm]
29	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	200 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar) (O ₂ :Ar = 1:50)	Rotation 10 U/min	(Pd ₅₂ Zr ₄₈)O _x	1000
30	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	200 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1200 (DC)	5×10^{-3} (Ar) (O ₂ :Ar = 1:50)	Rotation 10 U/min	(Pd ₅₂ Zr ₄₈)O _x	1000
31	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	200 (RF)	Al (200 mm Ø)	1000 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pd ₅₆ Al ₄₄	1000
32	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pd (200 mm Ø)	200 (RF)	Al (200 mm Ø)	1000 (DC)	5×10^{-3} (Ar) (O ₂ :Ar = 1:50)	Rotation 10 U/min	(Pd ₅₆ Al ₄₄)O _x	1000
33	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5×10^{-3} (Ar)	festst.	Pt	1000
34	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	1×10^{-2} (Ar)	festst.	Pt	1000
35	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	3×10^{-2} (Ar)	festst.	Pt	1000
36	Glaskugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	500 (RF)	-	-	5×10^{-2} (Ar)	festst.	Pt	1000
37	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	65 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1000 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pt ₂₁ Zr ₇₉	100
38	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	350 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1000 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pt ₅₄ Zr ₄₆	100
39	Steatitkugeln (2 mm Ø)	Pt (200 mm Ø)	350 (RF)	Zr (150 mm Ø)	1000 (DC)	5×10^{-3} (Ar)	Rotation 10 U/min	Pt ₅₄ Zr ₄₆	1000

55 Patentansprüche

1. Schalenkatalysator, hergestellt durch Abscheidung einer Legierung durch physical vapor deposition und/oder durch chemical vapor deposition auf einem Formkörper, wobei mindestens eine Legierungs-

komponente ein Metall aus der Gruppe von Aluminium, Gallium, Silizium, Germanium, Zinn, Blei, Wismut, Yttrium, Titan, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Eisen, Cobalt, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer, Silber, Gold und Zink ist.

- 5 2. Schalenkatalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mittels des PVD- und/oder CVD-Prozesses
 - a) eine homogene Schicht oder
 - b) eine säulenförmige oder poröse Schicht oder
 - c) eine Vielschicht mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung der Einzelschichten
 - 10 oder
 - d) eine Gradientenschicht mit kontinuierlich oder stufenförmig geänderter chemischer Zusammensetzung oder
 - e) ein Schichtsystem aus mindestens einer metallischen und mindestens einer oxidischen, nitridischen oder carbidischen Schicht aufgebracht wird.
- 15 3. Schalenkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Abscheidung durch
 - a) Kathodenzerstäubung eines oder mehrerer Targets in einem Edelgasplasma bei einem Druck zwischen 10^{-5} und 1 mbar oder durch
 - 20 b) reaktive Kathodenzerstäubung eines oder mehrerer Targets bei einem Druck zwischen 10^{-5} und 1 mbar in einem Plasma aus mindestens einem Edelgas und mindestens einem sauerstoff-, stickstoff- oder kohlenwasserstoffhaltigen Gas erfolgt,wobei die jeweiligen Targets aus reinen Metallen oder Metallegierungen oder aus Oxiden, Nitriden und Carbiden der entsprechenden Elemente bestehen und in homogener oder inhomogener Weise zusammengesetzt sind.
- 25 4. Schalenkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Abscheiden durch simultane Kathodenzerstäubung mehrerer Metalle aus der Gruppe von Aluminium, Gallium, Silizium, Germanium, Zinn, Blei, Wismut, Yttrium, Titan, Zirkon, Vanadin, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Eisen, Cobalt, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer, Silber, Gold und Zink erfolgt.
- 30 5. Schalenkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nachbehandlung der beschichteten Formkörper
 - a) durch Kontakt mit einem oxidierend und/oder reduzierend wirkenden Gasgemisch erfolgt oder
 - 35 b) mit einer Säure, insbesondere Flußsäure oder Salzsäure, oder einer Lauge erfolgt oder
 - c) durch eine thermische Behandlung erfolgt.
- 40 6. Schalenkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Legierung aus mindestens zwei verschiedenen Komponenten besteht, wobei die eine Komponente ein Element aus der Gruppe Palladium, Platin, Eisen, Kupfer, Nickel und Kobalt ist und die andere Komponente ein Element aus der Gruppe Zirkon, Titan, Aluminium und Silizium ist.
- 45 7. Schalenkatalysator nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Legierung Zirkon enthält.
- 50 8. Katalysatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Formkörpern um Kugeln, Tabletten oder Stränge aus Glas, Quarz, Keramik, Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Graphit, Metall oder Steatit handelt.
9. Katalysatorsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den Legierungen um amorphe oder nanokristalline Legierungen handelt.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 10 9837

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	EP-A-0 166 831 (DU PONT DE NEMOURS) * Seite 2, Zeile 23 - Zeile 32 * * Beispiel 5; Tabelle 1 * * Ansprüche 1,5,6,9 * ---	1,2,8	B01J37/02 B01J37/34
X	DE-A-2 507 636 (UNITED KINGDOM ENERGY AUTHORITY) * Ansprüche 1,10,25; Beispiel 1 * * Abbildungen 1,2 * ---	1-4	
X	EP-A-0 172 280 (DU PONT DE NEMOURS) * Ansprüche 1-8 *	1-4,8	
Y	---	6	
Y	EP-A-0 367 417 (FUEL CONSERVATION) * Anspruch 1 *	6	
X	EP-A-0 412 415 (BASF) * Anspruch 1; Beispiel 1 *	1,2,5	
X	DE-A-1 717 152 (DAIDO STEEL) * Anspruch 1 *	1	
	-----		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			B01J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort DEN HAAG		Abschließdatum der Recherche 06 OKTOBER 1993	Prüfer THION M.A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

Best Available Copy

EPO FORM 1503 03.92 (P0400)